



SEM用断面試料作製とSEM観察・分析のワークショップ

概要

センターでは、SEMおよびSEM用の断面試料作製の機器類を一新しました。
精密断面試料作製装置（ターゲット切断研磨機）といったユニークな機器もあります。
今回、個社を対象として、断面作製およびSEM観察・元素分析を行う実践的なワークショップを開催します。
試料の切断・研磨といった断面試料作製のノウハウを習得されたい方やご興味のある方はふるってご参加ください。

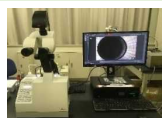
日程・定員 **令和6年10月24日（木）～11月19日（火）のうち、3時間**

	日程		内容	定員	備考
①	10月24日（木）	9：00～12：00	下記のうち、希望するコースを選択	1社1～2名程度	・各コース1社1回まで ・開始15分前より受付開始
②		13：30～16：30			
③	11月6日（水）	9：00～12：00			
④		13：30～16：30			
⑤	11月19日（火）	9：00～12：00			
⑥		13：30～16：30			

※上記①～⑥を基本としますが、10月24日（木）～11月19日（火）の間で調整も可能です。
申込の際に希望日を記入ください。（ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。）

A. 断面作製コース

サンプル
半導体デバイス



精密断面試料作製装置
切断と研磨をシームレスに加工



イオンミリング
高速イオンビームで表面を研磨

断面試料

B. SEM観察・元素分析コース

サンプル
半導体デバイス or
参加者持込み



オスミウムコータ
サンプル表面に導電性を付与



FE-SEM/EDS/WDS
高分解能観察・微量元素分析

受講料

各コース 5,000 円/人

受講料は当日現金にてお支払いください。
お釣りのいらぬようご準備をお願いいたします。

会場

大分県産業科学技術センター B204-1、B204-2（大分市高江西 1-4361-10）

講師

大分県産業科学技術センター 工業化学担当 職員

申込方法

URL、または二次元コードからアクセスの上、お申込みください

<https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/r6-work>

申込締切

開催希望日の1週間前（※参加上限に達した場合、早めに締切ることがあります。）

お問合せ

大分県産業科学技術センター 工業化学担当 上野、安部
TEL：097-596-7101、E-mail：i-chem@oita-ri.jp



※当日は、セミナーの様子を写真撮影して広報等に使用することがあります。
※お申込みいただいた内容は、本セミナーの運営管理に利用し、他の目的で利用することはありません。

